

第3日目：6月1日（木）

（ 9 ）

		9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
A 会場	1F 特別会議場										
B 会場	1F 中ホール A		S3 生体3次元イメージングと3次元解析技術 9:00-11:40			ランチョン 日本電子 12:00-13:00		B2. 生物系 II 13:20-15:40			
C 会場	1F 中ホール B		S6 走査型ナノプローブ技術との融合ナノ計測 9:00-11:50			ランチョン 日立ハイテク ノロジーズ 12:00-13:00		M2. 半導体 13:20-16:40			
D 会場	1F 107+108 会議室		I2. SEM 9:00-11:35			ランチョン 日本 FEI 12:00-13:00		I2. SEM 13:20-16:25			
E 会場	2F 小ホール		M7. その場観察 9:00-11:35			ランチョン 日本ローパー ガタン事業本部 12:00-13:00		M7. その場観察 13:20-14:05	OT7 14:15 14:45	M6. 表面・界面 14:55-16:10	
F 会場	2F 204 会議室		I1. TEM, STEM 9:00-11:50			ランチョン カールツァイス マイクロコピー 12:00-13:00		OT8 13:20 13:50	I1. TEM, STEM 14:00-16:00		
G 会場	2F 206 会議室		T2 電子光学設計 シミュレータと応用 9:30-11:30			ランチョン ケイエルブイ 12:00-13:00					
ポスター・ 展示会場	1F 大ホール	ポスター・写真展示 機器展示 9:00-15:00							撤去 15:00-17:00		
		9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00